



SelektLas

Selektiver und schädigungsarmer Laserabtrag von Schichtsystemen auf optischen Bauelementen

Bei Punkt- oder flächigen Fehlern in der Beschichtung hochwertiger Optiken müssen diese abgetragen und die Beschichtung repariert oder ersetzt werden. Bisher angewandte nasschemische Abtragsverfahren basieren jedoch oft auf Einsatz giftiger Chemikalien und erfordern oft einen vollständigen Schichtabtrag, während mechanische Verfahren meist nur auf planen Oberflächen anwendbar sind. Projektziel ist die Prozessentwicklung für einen schädigungsarmen, ortsoptimierten Abtrag durch Ultrakurzpulslaser. Hierfür sollen simulative Ansätze, experimentelle Untersuchungen und In situ-Messtechnik zur Parameter-Optimierung genutzt werden.

10/05/2024

Forschungseinrichtung

- Ernst-Abbe-Hochschule, Jena
- Laserinstitut Hochschule Mittweida

Förderung

- Geplanter Projektstart: 09/2024
- Laufzeit: 30 Monate
- Förderung: wird im Rahmen des BMWK-Programms "Industrielle Gemeinschaftsforschung" beantragt
- Beantr. Fördersumme: 525.000 €

Projektbegl. Ausschuss

- Carl Zeiss Jena GmbH
- JENOPTIK Optical Systems GmbH
- Laser Components Germany GmbH
- TTI - Technologie-Transfer-Initiative GmbH an der Univ. Stuttgart ^{KMU}
- ...

Kontakt

Forschungsvereinigung Feinmechanik,
Optik und Medizintechnik e. V. (F.O.M.)
Werderscher Markt 15, 10117 Berlin
info@forschung-fom.de
+49 (0)30 4140 2139

